



УТВЕРЖДАЮ

Д.В. Монастырский
Начальник НОЦ ФИПС
 « » ноября 2021 г.

По курсу повышения квалификации «Методологические основы патентных исследований» и по модулю программы профессиональной переподготовки 22-24 ноября 2021 г. (форма обучения: очная с применением дистанционных технологий)

ДАТА, аудитория	ВРЕМЯ	ТЕМА	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
31.05.21 г. Понедельник Бережковская наб., д.30, корп.1 Студия НОЦ Аудитория 866	10.00-10.30	Актуальные проблемы сферы интеллектуальной собственности	Начальник Научно-образовательного центра ФИПС МОНАСТЫРСКИЙ Денис Викторович
	10.35-11.20	Роль патентных исследований в обеспечении конкурентоспособности продукции	к.ю.н., патентный поверенный РФ и ЕАПВ, эксперт ВОИС КАЗЬМИНА Светлана Альектовна
	11.25-12.10		
	12.10-12.55		
	13.00-13.45	Перерыв	
13.45-14.30 14.35-15.20	Патентное описание как источник маркетинговых исследований	КАЗЬМИНА Светлана Альектовна к.ю.н., патентный поверенный РФ и ЕАПВ, эксперт ВОИС	

01.06.21 г. Вторник Бережковская наб., д.30, корп.1 Студия НОЦ Аудитория 866	10.00-10.45 10.50-11.35 11.45-12.30 12.35-13.20	Основные виды патентных исследований и их связь с жизненным циклом объекта техники.	КАЗЬМИНА Светлана Альектовна к.ю.н., патентный поверенный РФ и ЕАПВ, эксперт ВОИС <hr/> КАЗЬМИНА Светлана Альектовна к.ю.н., патентный поверенный РФ и ЕАПВ, эксперт ВОИС
	13.20-14.05	Перерыв	
	14.05-14.50 14.55-15.40	Разработка задания и регламента поиска	
02.06.21 г. Среда Бережковская наб., д.30, корп.1 Студия НОЦ Аудитория 866	10.00-10.45 10.50-11.35 11.45-12.30 12.35-13.20	Поиск, отбор и аннотирование источников информации Систематизация и анализ отобранной информации	КАЗЬМИНА Светлана Альектовна к.ю.н., патентный поверенный РФ и ЕАПВ, эксперт ВОИС <hr/> КАЗЬМИНА Светлана Альектовна к.ю.н., патентный поверенный РФ и ЕАПВ, эксперт ВОИС
	13.20-14.05	Перерыв	
	14.05-14.50 14.55-15.40	Оформление результатов патентных исследований	
	15.45-16.30	ЭКЗАМЕН	Д.В. Монастырский С.А. Казьмина

Примечание: В случае внесения изменений в расписание, информация будет оперативно доведена до всех заинтересованных лиц.